

Leica tisztaság vizsgáló rendszer műszaki leírása



A Leica tisztaság vizsgáló rendszer a jelenlegi speciális követelményekhez tervezve. A szennyeződések gyors és megbízható elemzéséhez a Leica tisztaság vizsgáló rendszere egy mikroszkópból áll, nagy felbontású digitális kamerából és az erre a célra kifejlesztett szoftverből.

A Leica tisztaság vizsgáló rendszer előnyei:

- Gyors és megbízható teljesítmény (külön felhasználói bejelentkezés, az összes mikroszkóp tárolása és visszahívása, kamera és szoftver beállítások).
- Automatikus felismerés a felhasználói befolyás minimalizálása érdekében.
- Átfogó annotációs eszköz kézi mérési funkcióval.
- Automatikus megkülönböztetés a fényvisszaverő és a nem tükröződő részecskék között a visszakövetés érdekében.
- Külön besorolás hossz és/vagy szélesség szerint.
- Részecskék magasságmérése (z-magasságmérés) (rendszerrel függően).
- 5 µm-es részecskék elemzése nemzeti és nemzetközi szabványok szerint (rendszerkonfigurációtól függően).
- A részecskék és szálak automatikus megkülönböztetése külön osztályozással.
- Élő információ, hogy korai visszajelzést kapjunk a legsúlyosabb szennyeződésről, hogy csökkentsük a válaszidőt.
- Szerkesztési funkció dokumentációval az eredmények egyszerű és megbízható ellenőrzéséhez.
- Konfigurálható Excel jelentések, beleértve a szűrőáttekintést, képeket és nyers adatokat.
- Megfelel a legújabb szabványoknak (ISO 16232, VDA 19, ISO 4406, DIN 51455, USP788, SAE AS4059, NAS 1638) a tisztaságérzékelésben.
- Bővíthető LIBS rendszerrel (DM6 M mikroszkóp esetén) a részecskeszennyeződés kémiai elemzéshez. Nincs szükség további minta-előkészítésre vagy szállításra.